

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08102549 A

(43) Date of publication of application: 16.04.96

The state of the s				
(51) Int. CI	H01L 33/00			
(21) Application number: 06236483		(71) Applicant:	ROHM CO LTD	
(22) Date of filing: 30.09.94		(72) Inventor:	TAJIRI HIROSHI	

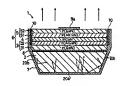
(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide light emitted from a semiconductive ight emitting element with fixed directionality and to improve light emission brightness by eliminating or reducing useless projection of light from a rear, etc., of a light transmitting substrate without using a reflector in a semiconductor light emitting element wherein a light transmitting substrate is used.

CONSTITUTION: In a semiconductor light emitting or element wherein a lamination part 6 comprised on n-type semiconductor layer 3, a light emitting layer 4 and a p-type semiconductor layer 5 is formed on a surface of a light transmitting substrate 2, a light trend on a surface of a light transmitting substrate 2, a light trom the light emitting layer 4 and passes through the light transmitting substrate 2 is formed in at least or such as the surface of the light transmitting substrate 2 is formed in at least substrate 2.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-102549 (43)公開日 平成8年(1996) 4月16日

(51) Int.CI. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 33/00	A			
	M			
	N			

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁

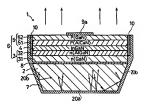
		潜血請求	未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)		
(21)出顧番号	特顯平6-236483	(71)出順人	000116024		
(22)出顧日	平成6年(1994)9月30日		口一厶株式会社 京都府京都市右京区西院清崎町21番地		
		(72)発明者	田尻 博		
			京都市右京区西院灣崎町21番地 ローム株 式会社内		
		(74)代理人	弁理士 吉田 稔 (外2名)		

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子

(57) 【要約】

【目的】 透光性基板を用いた半導体発光素子において透 光性基板の裏面などから光が螺板に出射されるようなこ とを反射器を用いることなく解剤し、または減少させる ようにし、もって半導体発光素子から発せられる光に一 定の方向性をもたせ、発光側度を高める。

【構成】選光性基度2の表面上に、 田型半導体層3、発 光層4、およびり型半導体層5から構成される機構感6 が形成されている半導体発光等であって、少なくとも 上記幾性性基板2の裏面2 aまたは各個面2 bには、上 記発光層4から発せられて速光性基板2を透過してくる 光を設計させるための光度制度7が形成されている。



【特許請求の範囲】

1 【請求項1】 透光性基板の表面上に、n型半導体層、 発光層、およびp型半導体層から構成される積層部が形 成されている半導体発光素子であって、

少なくとも上記透光性基板の裏面または各側面には、上 記発光層から発せられて透光性基板を透過してくる光を 反射させるための光反射膜が形成されていることを特徴 とする、半導体発光素子。

【請求項2】 上記光反射膜は、上記透光性基板の裏面 および各側面に形成されているとともに、

上記透光性基板の各側面は、これら各側面に形成されて いる光反射膜の内面側が透光性基板の表面側に向く傾斜 状となるように傾斜していることを特徴とする、請求項 1 に記載の半遺体発光素子。

【請求項3】 上記光反射隊は導電性材料によって形成 されているとともに、この光反射膜は、絶縁基板として の上記透光性基板の表面上に形成された積層部のうち最 下層に位置するn型またはp型の半導体層と導通して設 けられていることを特徴とする、請求項2に記載の半導 体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本額発明は、たとえば青色発光L EDのようにサファイア基板などの透光性基板が用いら れるタイプの半導体発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年においては、サファイア基板上に窒 化ガリウム系の半導体層を形成することにより、青色の 発光が得られるようにした青色LEDが種々開発されて いるが、上記サファイア基板は透明基板である。したが 30 って、n型およびp型の両半導体層の間に形成された発 光層から発せられた光は、其板表面上に積層された半漢 体層のうち最表層の部位や発光層の側面部から外部へ出 射する他、透明基板を透過して透明基板の下方向へも出 射する。これでは、LEDランプを製作する場合におい て、半導体発光素子の上面側において高い発光輝度が得 られない。また、光が様々な方向に散乱し、一定の方向 性をもたせることもできない。

[0003] そこで、従来では、皿状に形成された金属 製の反射器内に半導体発光表子を配置させてダイボンド 40 することにより、透光性基板の裏面などから出射する光 を反射器によって一定方向へ反射させるようにしてい

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の反射器を用いる手段では、反射器を別途必要とする ために、LEDランプを製造する際の全体の部品点数が 増加し、その製造コストが高価となる難点があった。ま た、反射器のサイズは半導体発光素子よりもかなり大き なサイズに形成する必要がある。したがって、この反射 50 る。

器を組み込む必要性から、LEDランプ全体が大型化す るという難点も生じていた。

【0005】本願発明は、このような事情のもとで考え 出されたものであって、透光性基板を用いた半導体発光 素子において透光性基板の裏面などから光が無駄に出射 されるようなことを反射器を用いることなく解消し、ま たは減少させるようにし、もって半導体発光素子から発 せられる光に一定の方向性をもたせ、発光額度を高める ことをその課題としている。

[0006] 10

> 【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた め、本願発明では、次の技術的手段を講じている。

> 【0007】すなわち、本願の請求項1に記載の発明 は、透光性基板の表面上に、n型半導体層、発光層、お よびp型半導体層から構成される積層部が形成されてい る半導体発光素子であって、少なくとも上記透光性基板 の裏面または各側面には、上記発光層から発せられて透 光性基板を透過してくる光を反射させるための光反射膜 が形成されていることを特徴としている。

【0008】本願の請求項2に記載の発明は、上記請求 項1に記載の半導体発光素子において、上記光反射膜 は、上記透光性基板の裏面および各側面に形成されてい るとともに、上記透光性基板の各側面は、これら各側面 に形成されている光反射膜の内面側が透光性基板の表面 側に向く傾斜状となるように傾斜していることを終微と している。

【0009】本顧の請求項3に記載の発明は、上記請求 項2に記載の半導体発光素子において、上記光反射膜は 導電性材料によって形成されているとともに、この光反 射膜は、絶縁基板としての上記透光性基板の表面上に形 成された積層部のうち最下層に位置するn型またはp型 の半導体層と導通して設けられていることを特徴として いる。

[0010]

【発明の作用および効果】上記請求項1に記載の発明に おいては、少なくとも透光性基板の裏面または各側面に は光反射膜が形成されているために、発光層から透光性 基板の裏面側方向に発せられた光を、この光反射膜によ って透光性基板の表面側へ反射させることができる。し たがって、透光性基板の裏面または側面から漏れを生じ る光量を減少させて、透光性基板の積層部の最表層の部 位から出射する光量を増加させることができる。

【0011】その結果、従来に比較して、発光輝度を高 め、またその光に一定の方向性をもたせることができ る。したがって、発光ランプを製造する場合において は、発光輝度の向上などを目的として必ずしも皿状など の反射器を用いる必要はなくなり、部品点数の削減によ る発光ランプの製造作業の容易化、ならびに発光ランプ の小型化を図ることができるという格別な効果が得られ

【0012】請求項2に記載の発明においては、光反射 膜が透光性基板の裏面および各側面に形成されているこ とにより、発光層から透光性基板の裏面側方向に発せら れた光のほぼ全量を透光性基板の表面側へ反射させるこ とができるばかりか、透光性基板の各側面が傾斜してい ることにより、これら各側面に形成された光反射膜にあ たった光を直接的に、かつ効率よく透光性基板の表面側 へ反射させることもできる。したがって、半導体発光素 子の表面側における発光輝度を一層高めることができる という効果が得られる。

【0013】請求項3に記載の発明においては、光反射 膜が導電性材料によって形成され、しかもこの光反射隙 が絶縁基板としての透光性基板の表面に形成された積層 部のうち最下層に位置する半導体層に導通しているため に、この光反射膜を積層部の最下層に位置する半導体層 についての電極として機能させることが可能となる。し たがって、最下層の半導体層に対して電極を別途設ける 必要を無くし、電極形成作業の簡素化を図ることができ るという利点が得られる。

【0014】また、このように透光性基板の裏面に形成 20 されている光反射膜を電極として機能させることができ るために、この光反射膜をリードフレームなどに導電接 着させれば、最下層の半導体層に対して金線を用いたワ イヤポンディング作業を行う必要も無くすことができ る。したがって、半導体発光素子のポンディング作業も 容易に行え、発光ランプの製造作業能率を一層良好にで きるという効果も得られる。

[0015]

一例を示す断面図である。

[実施例の説明] 以下、本願発明の好ましい実施例を、

図面を参照しつつ具体的に説明する。 [0016] 図1は、本願発明に係る半導体発光素子の

【0017】図1に示す半導体発光素子1は、青色LE Dとして構成されたものであり、透光性基板としてのサ ファイア基板2の表面に、n型半導体層3、発光層4、 およびp型半導体層5から構成される積層部6を形成し たものである。また、この稗層部6およびサファイア基 板2の各側面やサファイア基板2の裏面には、光反射膜 7が形成されている。

上に窒化ガリウムのパッファ層8を成長させ、その表面 に順次 n 型半導体層 3 などを形成したものである。 積層 部6の具体的な構成としては、n型半導体層3が、n型 GaN層31、およびn型A1GaN層32 (A1o.2 G ao. s N) によって形成されている。発光層 4 は、 I nGaN層 (Ino.15 Gao.85 N) によって形成されて いる。また、p型半導体層5は、p型A1GaN層51 (A 1 e. 2 Gae. 8 N) 、およびp型GaN層52によ って形成されている。このうち最表層のp型GaN層5

成されている。なお、上記各層の厚みは、下層側から各 層31、32、4、51、52の順に、たとえば3 μ m, 300nm, 50nm, 300nm, 150nmk 設定されている。

【0019】上記サファイア基板2は、その厚さが10 分の数mm程度であり、透光性を有する他、電気絶縁性 を有するものである。このサファイア基板2は、たとえ ば平面矢視において一辺が0.5mm程度の正方形状の チップに形成されているが、その各側面20bはテーバ 10 状に形成されている。

【0020】上記光反射膜7の具体的な材質としては、 光の反射率が比較的高く、かつ導電性を有するA1. C u、Crなどが採用されている。この光反射膜7は、上 記サファイア基板2の裏面20g、テーパ状の各側面2 0 b、および積層部6の各側面にわたって形成されてい る。ただし、積層部 6 のうち最下層の n 型 G a N層 3 1 を除く他の半導体層の側面には、酸化シリコンなどの絶 緑膜10が形成されており、これにより上記光反射膜7 が積層部6のn型GaN層31以外の半導体層に導通し ないようになっている。これに対し、最下層のn型Ga N層31の側面には締録職10は静けられておらず。ト 記光反射膜7はこのn型GaN層31の側面と導通接触 している.

【0021】上記半導体発光素子1の製造方法の具体例 としては、まず有機金属化学気相成長法(MOCVD 法) によって、サファイア基板2上に所定成分の単結晶 を順次成長させて積層部6を形成する。次いで、サファ イア基板2の各側面20bをテーパ状に形成する加工 や、上記積層部6の側面の所定箇所に絶縁膜10を形成 30 する処理を行う。サファイア基板2の各側面20bをテ ーパ状に形成する加工は、エッチングにより行える他、 サファイア製のウエハをダイシングするためのダイヤモ ンド刃の刃先をテーパ状に形成しておくことによっても 行える。そして、その後は、上記積層部6の側面や、サ ファイア基板2の裏面20aや各側面20bに光反射跳 7を形成するためのA1などの材料をスパッタリングな どによって被着させ、成膜させればよい。

【0022】上記構成の半導体発光素子1を用いて発光 ランプを製作するには、たとえば図2に示すように、リ 【0018】上記積層部6は、サファイア基板2の表面 40 ードフレーム25のリード25a上に半導体発光素子1 を載置し、光反射膜7を導電性接着剤を介して接着させ ればよい。光反射膜7は、最下層のn型GaN層31と **導通しているために、これにより**n型GaN層31をリ ード25aに導通させることができる。したがって、半 導体発光素子1のワイヤポンディングは、1本の金線2 6を用いて電極9aをリード25bに接続させるだけで よく、ポンディング作業が容易となる。

【0023】上記ダイボンディングが行われた状態にお いて、半導体発光素子1に賃流供給を行うと、発光層4 2の上面には、Ti、Au、Ni製などの電板9aが形 50 が青色に発光するが、その光は最表層のp型GaN層5

2の部位から上方向へ出射する他、下方向や水平方向に も発せられる。ところが、下方向の光がサファイア基板 2を透過すると、このサファイア基板2の裏面2aや側 面2bに形成された光反射膜7によって上方向に反射さ れる。

[0024]とくに、サフィグ基板20名側面20に 形成された光反射版7は、その内面側がウフィブ基板 20表面積を向く傾斜状に形成されているから、これら 各側面20に到達した光は、その傾斜状の光反射膜7に よって効率よく上方向に反射され、最表層のP型GaN 10 層520能位から上方へ出射する。さらに、水平方向の 光も、観層低60分側面に設けられた光圧射膜7によっ で内側に反射されることにより、外径、端れを生じるこ とが防止され、半導体発光素子1内における反射を離り 返すとこにより、やはり最長層0p数GaN層52の部 位から上方へ組材する。

【0026】 また、上配したように光に上向きの方向性 を持たせて、その発光輝度を高めることができれば、発 光ランプを製作するに際し、従来用いられていた皿状の 反射器を用いる必要はなくなる。したがって、発光ラン プの製作の容易化、および小彩化も図れる。

[0027] 本礼、上記集施所では、光度付照7をサフタイア基板2に設けるだけではなく、精層権6の側面にも形成したが、本盤原明は必ずしもこれに設定されない。たとえば、図3に示すように、光反射線7を使用部6の側面には形成せず、サフィイ基板2の裏面2aや各側面2bにのみ形成してもよい。この場合には、発光層4の側面から横方向へ発せられる光を大配射線7によって反射させることができず、光の漏れを生じさせてしまうが、発光層4から下方向に発せられる光については、光反射線7によって上方向に反射させることができ、や状度が最少によって上方向に反射させることができ、や状度が振りによって上方向に反射させることができ、や状度が振りてよって上方向に反射させることができ、や

[0028]また、積層部6の全体の所み寸法は、たと 式は4mに満分なれり板であるのに対し、サファイア 基板2の所みは数百μm程度であり、積層部6に比較す るとサファイア基板2は圧倒的に大きた原みである。こ のため、発光網への側面から機がか、発せられる光の最 は、サファイア基板2を迅速して下方的などに発せられ る他の光の最に比較するとかなりからいのが実情であ る。したがつて、発光層4の側面から機方向、発せられ る光を反射させなくても、その発光順度が、図1で示し、 を実備の場合とドルサルドナを属で下す&とうなことは ない。

【0029】また、上記図1で示した実施学では、光反 射観7の一部を n型 G n N層 3 l に準適させ、ポンディ ング作業などに便宜が図れるようにしているが、領決項 3 に対対)、請決項 1 および2 に記載のか縄発明込みず もされた限定されない、上記図3 で示した半導体発光 素子のように、復帰部6の一部の 製域3 をエッチング し、程下層0 n型 G n N層 3 l の上面に、電極9 b を形 板してもよい。

(0030] さらに、上記図1および832に示した各集 施例では、サファイア基板2の各側面2もを傾斜状に形 成しているが、(研究項2に対対)、 (開究項1に配慮の本 発現明はこれに限定されない。たとえば図4に示すよう に、サファイア基板2の各側面20を傾斜状に形成せ ず、裏面20と直交する側面20とでもたい。このような 構成であっても、サファイア基板2を搭送してくる光を 光反射線アによって反射させることでき、外部への光の 繊和を防止することできる。そして、多数回の光反射が 繰り返されることにより、サファイア基板2の上拠方向 ペ本を単純さまと、たば7000年20

[0031]さらに、本願発明は、図5または図6に示すように構成しても構わない。すなわち、図5に示す의 事体発光業子では、光度制度でセサフィア基度の 面2aのみに設けた構成である。このような構成では、 サファイア基板2の制面2bに到達した光は外部に遅れ を生じるが、それ以外の大事の分だこかには光度制御? によって上方向へ反射させることができる。したがって、後来に比較すると、やはり発光質度を高めることができる時かられる。

[0032] 図6に示す半導体発光素子では、サファイ ア基板2の各側面2bのみに光反射膜7が設けられてい る。このような構成では、この半導体発光素子単体で は、発光層 4 から下向きに発せられる光を適切に上方向 へ反射させることはできない。しかし、この半減体発光 素子をリードフレームなどの所定箇所にダイボンディン グする場合において、そのボンディング面27が光の反 射作用を有する場合があり、このような場合にこの半導 体発光素子が用いられる。すなわち、この半導体発光素 子では、上記ポンディング面27を反射面として利用 40 し、下方向に発せられる光を効率よく上方向へ反射させ るようにポンディングを行って使用する。そして、サフ ァイア基板2の各側面2bに到達する光については、光 反射膜7によって内側へ反射させることができる。 した がって、この場合においても、従来に比較して発光輝度 を高めることが可能である。

は、サファイア基板を全活場して下方内などに発せられ る他の外の最には対するとかねらからかのが実情であ る。したかって、発光層4の前面から積方向へ発せられ る光を反射させなくても、その発光模型が、図1で示し 大変譜的母患や上秋して大塚に低下するようなことは 図 型キ海条 最大空の春の具体的な母質なども限定され (5)

特開平8-102549

ず、各部の具体的な構成は種々に設計変更自在である。 【図面の簡単な説明】

【図1】本職発明に係る半導体発光素子の一例を示す断 面図。

面図。 【図2】図1に示す半導体発光素子のダイボンディング

の一例を示す説明図。 【図3】本願発明に係る半導体発光素子の他の例を示す

【図3】本願発明に係る半導体発光素子の他の例を示す 断面図。

【図4】本願発明に係る半導体発光素子の他の例を示す 断面図。

断面図。 【図 5 】本願発明に係る半導体発光素子の他の例を示す 断面図。

【図6】本職発明に係る半導体発光素子の他の例を示す 断面図。

[符号の説明]

1 半導体発光素子

2 透光性基板 (サファイア基板)

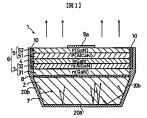
3 n型半導体層

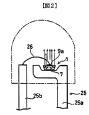
4 発光層

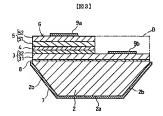
4 光元間

5 p型半導体層

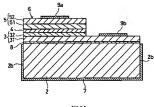
6 積層部 7 光反射膜



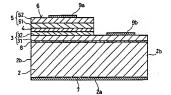




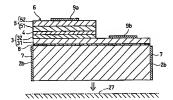




[図5]



[図6]



000